DOI: 10. 19650/j. cnki. cjsi. J2210808

基于二次调制原理的多层结构绝对式角位移传感器*

刘小康,康成蓥,于治成,郑方燕,王合文

(重庆理工大学机械检测与装备技术教育部工程研究中心 重庆 400054)

摘 要:为了在传感器径向尺寸不变的前提下,保持良好的测量精度和分辨率,以适应小型化需要的工业场合,提出了一种利用 多层结构实现信号二次调制的圆时栅角位移传感器。传感器为3层结构,利用轴向空间,使内外环分别通过多层结构完成信号 的二次调制,其中内环作为粗测环经二次调制后用于实现传感器的绝对定位,外环作为精测环经二次调制后,提高了传感器分 辨率。采用 PCB 工艺制造了外径 **Φ**=100 mm,内径 **Φ**=50 mm 的传感器样机,初步实验表明内外环同时施加激励时,内外环将 分别受到对方产生的串扰影响,因此进一步提出分时施加激励的优化方法避免信号串扰的影响以提升测量精度。最终实验结 果表明传感器能够实现绝对定位且分辨率提升了1倍,原始测量精度达到了±4.1"。 **关键词:** 角位移传感器;多层结构;二次调制;绝对式;分时结构

中图分类号: TH712 文献标识码: A 国家标准学科分类代码: 460. 4030

Multilayer absolute angular displacement sensor based on the re-modulation method

Liu Xiaokang, Kang Chengying, Yu Zhicheng, Zheng Fangyan, Wang Hewen

(Engineering Research Center of Mechanical Testing Technology and Equipment, Ministry of Education, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054, China)

Abstract: To meet the industrial needs of miniaturization and maintain favorable precision and resolution, a circular time-grating angular displacement sensor is proposed by using multi-layer structure and re-modulation scheme. The sensor is a three-layer structure. Its inner and outer rings complete the re-modulation of the signal through the multi-layer structure by using the axial space. The inner ring is used as the rough measurement part to realize the absolute positioning and the outer ring through re-modulation is used as the fine measurement part to improve the resolution of the sensor. A prototype sensor with an outer diameter of $\Phi = 100$ mm and an inner diameter of $\Phi = 50$ mm is manufactured by PCB technology. Preliminary experiments show that when the inner and outer rings are excited at the same time, the inner and outer rings are affected by the crosstalk generated by each other. Therefore, a time division method is further proposed to avoid the influence of signal crosstalk to improve the measurement part is doubled, and the original measurement accuracy reaches ±4. 1". Keywords; angular encoder; multilayer structure; re-modulation scheme; time division structure; absolute type

0 引 言

制造业是我国经济"创新驱动、转型升级"的主战 场,"中国制造 2025"以及"工业 4.0"的实现需要精密检 测技术的发展与支持^[1-3]。精密角位移测量装置作为核 心零部件在半导体、航天军工、机器人、数控机床等高端 制造领域发挥着重要作用^[47]。

光栅角位移测量技术应用广泛,各研究单位为提高 光栅的精度与分辨率对光栅的绝对编码技术、光栅制造 技术、细分技术等方面进行了细致深入的研究^[8]。绝对 式光栅编码技术可分为多码道编码技术、双码道编码技

*基金项目:国家自然科学基金(51935004,52125503)、重庆市教委"成渝地区双城经济圈建设"科技创新项目(KJCX2020043)、重庆市教委科学技术研究项目(KJQN202001133)、重庆理工大学科研创新团队项目(2023TDZ008)资助

收稿日期:2022-11-30 Received Date: 2022-11-30

术以及单码道编码技术,多码道编码方式的出现意味 着位移测量由增量式向绝对式转变,但其相较于双码 道和单码道编码不利于传感器小型化,结构更加复杂, 因此,相关研究重点多集中于双码道和单码道编码技 术^[9-11]。高密度的编码需要高密度、高一致性的栅线刻 划,增加栅极密度是提升光栅精度与分辨率最直接的 方法。栅线制造主要有机械刻线技术和光学蚀刻技术 两种,机械刻线技术可制造小栅距的光栅,但耗时长, 无法实现大规模的生产,其与纳米滚压印技术相结合 可实现产业化生产,却难以保证刻线的一致性^[12]。光 学蚀刻技术可制造出高精度、细间距的栅线,在早期此 种技术限制了光栅尺寸,研究人员通过可移动的曝光 源等复杂工艺使其适用于大尺寸、高密度的栅线制造, 其制造成本和时间成本也大幅提高[13-15]。受制于光学 特性、工艺特性、制造成本等限制,并不能无限减小栅 线栅距以提高光栅的精度和分辨率.因此研究人员还 通过电气插值和光学插值等细分方法提高光栅分辨 率[16-17]。总体而言,光栅发展成熟、精度高,海德汉公 司生产的 RCN8000 系列圆光栅系统精度已达到±1",但 存在制造成本高,编码技术复杂,光学物理特性限制精 度和分辨率进一步提高等复杂因素。

电容式编码器相较于光栅具有易于制造、功耗低的 优点,在测量中对位移变化有着出色的敏感性[18-19]。目 前实用的容栅位移测量系统多采用调相型,其不需要类 似于光栅进行高精度、高密度的栅线刻划,使得成本大幅 降低。清华大学的 Hou 等^[20]提出了一种由不同形状电 极构成的电容式角编码器,通过对耦合电极形状的优化 设计,使其精度达到 0.003 6°。电容式角编码器可通过 精测与粗测结合等结构实现绝对定位,整体而言,电容式 角编码器的精度较光栅还存在一定差距,边缘效应、寄生 电容制约了其测量精度和分辨率进一步的提高,随着容 栅的不断发展,上述问题也在不断地改善中^[21]。本人所 在研究团队提出了一种电场式时栅测量方法,采用栅面 传感,避免了细密栅线刻划,相较于光栅大幅降低了制造 和生产成本,具有容栅结构简单、位移敏感性高的优点。 此外,其很好的利用了电容滤波效应的优点,较好地抑制 了寄生电容影响^[22-23]。

为了在传感器径向尺寸不变前提下,提高传感器的 测量精度和分辨率,提出了一种基于二次调制原理且采 用多层结构的绝对式时栅角位移传感器。传感器为3层 结构,利用传感器轴向空间,实现了多层结构与二次调制 原理的结合。通过对传感器内外环分时施加激励,内外 环经过二次调制分别产生粗测感应信号与精测感应信 号。内环粗测环实现了绝对定位,外环精测环经二次调 制后分辨率提升了1倍,分时方法则避免了信号串扰影 响,减小了寄生电容,进一步提高了测量精度。

1 电场式圆时栅测量原理

电场式圆时栅采用四路交变电场进行电场耦合将空间角位移变化转化为电场信号在相位上的移动,从而实现对角度的测量,如图1(a)所示为增量圆时栅传感器的结构示意图。



图 1 增量式时栅传感器测量原理

Fig. 1 Principle of the incremental time-grating sensor

传感器为双层结构,包括定子、转子、电路处理模块 3部分,定子上覆有单列的环扇形激励电极,将4片激励 电极称为一个对极,在圆周上均布N个对极,则每个对极 空间角度为2π/N。对应的转子上覆有N个双正弦型的 感应电极,定子与转子正对平行安装,转子可绕轴心相对 转动。

传感器转子转动时,可视作变面积的平板电容。如 图 1(b)所示,对激励电极施加幅值、周期相等,相邻相位 相差 π/2 的正弦交流激励:

$$\begin{cases} U_{S+} = + A_m \sin(\omega t) \\ U_{C+} = + A_m \cos(\omega t) \\ U_{S-} = - A_m \sin(\omega t) \\ U_{C-} = - A_m \cos(\omega t) \end{cases}$$
(1)

式中: A_m 为激励信号的幅值; ω 为激励信号的频率;t 为时间。同一个对极内单个激励电极在转子对应感应电极 产生的感应信号受施加的激励 U_i 及定转子极片正对面 积 ΔS_i 影响,可表示为:

 $U_{0i} = K_e \Delta S_i U_i \tag{2}$

式中: K_e 为电场耦合系数; ΔS_i 为激励电极与感应电极的 正对面积; U_i 为施加到激励电极的激励。

当转子绕轴心转动时, ΔS_i 为转动角 θ 的函数,以施加激励信号为 $U_{s_{*}}$ 的激励极片与感应极片的正对面积 $\Delta S_{s_{*}}$ 为例,当转子转动时,其面积变化形式为:

 $\Delta S_{s+} = 2r\Delta r [1 - \cos(N\theta)]$ (3) 式中:r为转子上双正弦电极所在的圆周半径;Δr为双正 弦形电极的幅值形式。同理可分别得到 ΔS_{c+} 、 ΔS_{s-} 、 ΔS_{c-} 。将 ΔS_i 与式(1)代入式(2)可以得到 4 片激励电 极在感应电极上产生的感应信号:

$$\begin{cases} U_{o_{S^{+}}} = 2K_{e}A_{m}r\Delta r[1 - \cos(N\theta)]\sin(\omega t) \\ U_{o_{C^{+}}} = 2K_{e}A_{m}r\Delta r[1 + \sin(N\theta)]\cos(\omega t) \\ U_{o_{S^{-}}} = -2K_{e}A_{m}r\Delta r[1 + \cos(N\theta)]\sin(\omega t) \\ U_{o_{C^{-}}} = -2K_{e}A_{m}r\Delta r[1 - \sin(N\theta)]\cos(\omega t) \end{cases}$$

$$(4)$$

将同一个对极内四路激励电极在单个感应电极产生的感应信号叠加,则单个感应电极上得到的最终感应信号为:

$$U_{0} = U_{0S+} + U_{0C+} + U_{0S-} + U_{0C-} =$$
(5)

 $- 4K_e A_m r \Delta r \sin(\omega t - N\theta) = K \sin(\omega t - N\theta)$ 式中: $K = -4K_e A_r \Delta r$ 为感应信号的幅值: $N\theta$ 为感应信号

的相位形式。如图 1(b)所示,感应电极按照一个对极宽度的间隔进行圆周阵列均布,使得感应电极在空间分布 上两两相位相差 2π ,则相邻感应电极产生的感应信号相 位相差 2π ,每个感应电极得到的感应信号均为 $K\sin(\omega t - N\theta)$.将所有感应电极串联从而得到最终的感应信号。

增量电场式圆时栅传感器将空间中转动角度θ转化 为信号上相位的变化,对相位进行测量可得到传感器的 位移值,实现角度测量,但无法实现绝对定位,且增加传 感器分辨率和精度依赖于对极数增加,从而增大了传感 器的径向尺寸,不利于小型化。

2 基于二次调制的绝对式编码器测量原理

2.1 多层结构设计

多层圆时栅传感器为3层结构,通过内外环的精测 环与粗测环实现绝对定位,并通过利用轴向空间实现信 号二次调制,提升传感器的分辨率和测量精度。图2(a) 为传感器整体示意图,顶层为定子Ⅰ,底层为定子Ⅱ,中 间层为转子,转子分为A、B两面,其通过内部引线将A、 B两面电极进行连接。图2(b)所示为传感器信号流向 示意图,定子Ⅰ内外环与转子A面内外环分别耦合产生 第一级内环粗测感应信号与第一级外环精测感应信号, 将第一级感应信号作为激励信号通过内部引线并按照一 定顺序施加到转子B面内外环并与底层定子Ⅱ内外环耦 合实现二次调制得到第二级内环粗测感应信号和第二级 外环精测感应信号。

图 2(c) 所示为定子 I、定子 II 以及转子的栅面结构 示意图,定子 I 上覆有两列激励电极分别为第一级内环



图 2 多层传感器结构示意 Fig. 2 Structure of the multi-layer sensor 激励电极和第一级外环激励电极,均为 N 对极;转子 A 面覆有两列感应电极分别为第一级内环感应电极和第一 级外环感应电极;转子 B 面覆有两列激励电极称为第二 级内环激励电极和第二级外环激励电极,其中内环设为 N-1 对极,外环设为 N 对极;定子 Ⅱ 覆有两列感应电极 称为第二级内环感应电极和第二级外环感应电极。

传感器工作时,定子与转子平行正对安装,定子 I、 II固定,转子可绕轴心相对转动。传感器通过利用轴向 空间完成信号的二次调制,传感器内环得到实现绝对定 位的第二级粗测感应信号,外环得到分辨率翻倍的第二 级精测感应信号。

2.2 传感器二次调制实现原理

传感器在增量式的基础上通过多层结构实现信号的 二次调制,从而提高传感器的分辨率,如图 2(d)所示为第 一级耦合的原理,第一级内外环激励电极均为 N 对极,在 第一级对转子 A 面内外环的双正弦感应电极,按照 3/4 对 极宽度在圆周上均布感应电极极片,则相邻四片感应电极 上得到的感应信号相位将会依次相差 3/4×2π=3π/2 即π/2,结合前文公式,将同空间相位的感应极片串联可得到 内外环第一级粗测信号与精测信号分别为:

$$\begin{cases} U_{c1} = -4K_{c}A_{m}r_{1}\Delta r_{1}\sin(\omega t - N\theta) = \\ K_{1}\sin(\omega t - N\theta) \\ U_{c2} = -4K_{c}A_{m}r_{1}\Delta r_{1}\sin(\omega t - N\theta - \pi/2) = \\ -K_{1}\cos(\omega t - N\theta) \\ U_{c3} = -4K_{c}A_{m}r_{1}\Delta r_{1}\sin(\omega t - N\theta - \pi) = \\ -K_{1}\sin(\omega t - N\theta) \\ U_{c4} = -4K_{c}A_{m}r_{1}\Delta r_{1}\sin(\omega t - N\theta - 3\pi/2) = \\ K_{1}\cos(\omega t - N\theta) \\ U_{f1} = -4K_{c}A_{m}r_{2}\Delta r_{2}\sin(\omega t - N\theta) = \\ K_{2}\sin(\omega t - N\theta) \\ U_{f2} = -4K_{c}A_{m}r_{2}\Delta r_{2}\sin(\omega t - N\theta - \pi/2) = \\ -K_{2}\cos(\omega t - N\theta) \\ U_{f3} = -4K_{c}A_{m}r_{2}\Delta r_{2}\sin(\omega t - N\theta - \pi) = \\ -K_{2}\sin(\omega t - N\theta) \\ U_{f3} = -4K_{c}A_{m}r_{2}\Delta r_{2}\sin(\omega t - N\theta - \pi) = \\ -K_{2}\sin(\omega t - N\theta) \\ U_{f4} = -4K_{c}A_{m}r_{2}\Delta r_{2}\sin(\omega t - N\theta - 3\pi/2) = \\ K_{2}\cos(\omega t - N\theta) \end{cases}$$
(7)

式中: $K_1 = -4K_e A_m r_1 \Delta r_1$ 为第一级内环粗测感应信号的 幅值; $K_2 = -4K_e A_m r_2 \Delta r_2$ 为第一级外环精测感应信号的幅 值; $N\theta$ 为第一级粗测信号和精测信号的相位。第一级粗 测信号与第一级精测信号满足作为传感器激励信号四路 幅值两两相差 $\pi/2$ 的条件,可以作为第二级的激励信号 从而实现二次调制。

如图 2(e) 所示,将第一级内环粗测感应信号按照相 邻相位相差-π/2 即 U_{e1}、U_{e2}、U_{e3}、U_{e4} 的顺序施加到转子

B 面内环 N-1 个对极的激励电极上;将第一级外环精测 信号作为激励信号按照相邻相位相差 $\pi/2$ 即 U_{f1} 、 U_{f4} 、 U_{f3} 、 U_{f2} 的顺序施加到转子 B 面外环 N 个对极的激励电 极上。根据式(2)~(5),可得到最终的粗测感应信号与 精测感应信号分别为:

对比式(8)与(6),粗测信号经二次调制,对极数等 效于1,用于整周范围内粗测以实现绝对定位。对比 式(9)与(7),精测信号通过二次调制,融合了传感器外 环第一级与第二级的位置信息,在未增加传感器径向尺 寸前提下,传感器对极数由 N 增加到 2N,使得传感器的 分辨率对应提升了一倍,测量精度得到提高。

为了提升传感器抗干扰能力,进一步将定子 II 第二 级内外环感应电极采取差动结构,以外环为例,感应电极 按照 1/2 对极宽度在圆周上均布感应电极极片,则相邻 两片感应电极上得到的感应信号相位将会依次相差 1/2 ×2π=π,即:

$$\begin{cases} U_{fine1} = K_{fine} \sin(\omega t - 2N\theta) \\ U_{fine2} = K_{fine} \sin(\omega t - 2N\theta + \pi) = \\ -K_{fine} \sin(\omega t - 2N\theta) \end{cases}$$
(10)

假设干扰信号为 U_{ε} ,差动结构改进后在信号处理电路中进行相减:

$$U_{fine} = U_{fine1} + U_E - (U_{fine2} + U_E) =$$

$$2K_{fine} \sin(\omega t - 2N\theta)$$
差动结构可以有效消除外界的共模干扰信号。

2.3 传感器绝对定位实现

图 3 所示为传感器绝对定位测量示意图,由式(9)可 知,得益于二次调制,传感器精测信号表达式中相位角为 2Nθ,转子每转动 π/N 的角度,传感器精测信号相位 φ 相 移 2π,如图 3 所示可表示为周期为 π/N 的函数:

$$\begin{cases} \varphi(\theta) = 2N\theta, \quad \theta \in [0, \pi/N] \\ \varphi(\theta) = \varphi\left(\theta + \frac{\pi}{N}\right), \quad \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$$
(12)

传感器粗测部分经过调制对极数相当于 1,相位角为 θ ,当传感器相对转动角度 $\theta \in [0,2\pi]$ 时,对应信号相位移动范围为 $\Phi \in [0,2\pi]$,如图 3所示有如下关系:

$$\Phi(\theta) = \theta, \theta \in [0, 2\pi]$$
(13)

若粗测部分测量的角位移的误差小于精测部分调制 后单个对极对应的角度即 π/N,则粗测部分可以识别精 测部分当前所处的对极位置以实现绝对定位,传感器输 出的角度值可表示为:

$$\theta_{out} = \theta_{coarse} + \theta_{fine} = \frac{\pi}{N} \operatorname{int}\left(\frac{\Phi}{\pi/N}\right) + \frac{\varphi}{2N}$$
 (14)

式中: $\theta_{coarse} = \frac{\pi}{N} int\left(\frac{\Phi}{\pi/N}\right)$ 表示粗测信号测得的传感器转

过的整数个对极; $\theta_{fine} = \frac{\varphi}{2N}$ 表示当前对极内精测角度;传感器通过粗测部分和精测部分实现了传感器的绝对定位。



Fig. 3 Method of absolute positioning measurement

3 实验系统设计

3.1 传感器样机设计与实验平台搭建

为验证所提出的传感器的性能,制作了外径 100 mm、内径50 mm的传感器样机,第一级内外环对极 数均为60,第二级内环对极数为59,外环对极数为60,搭 建了如图4所示的实验平台。



图 4 实验平台 Fig. 4 Experiment platform

该平台使用英国 RPI 公司的 AP300 精密气浮转台, 在 360°范围内能实现±0.4"的定位精度。传感器安装到 机械工装上,由工控机控制并显示转台的位置信息,由信 号处理板采集传感器位置信息,上位机进行显示。安装 时保证定子、转子、转台 3 者同心,定子和转子相对平行, 定子 I、II 与转子的间隙均为 0.2 mm。实验平台位于地 下超洁净实验室,具有恒定的温度与湿度,可有效隔绝外 部环境干扰。

3.2 测量系统设计

图 5 为传感器信号处理过程,电路处理模块中 FPGA 与 DA 转换器、运算放大器组成信号发生器,产生所需的 交流激励信号。传感器经两级调制后得到最终的粗测信 号与精测信号,信号经差分放大并滤波后通过比较器将 模拟信号转换为数字信号。转换后的感应信号将保留表 征位置信息的相位信息,在 FPGA 中以高速时钟内插实 现相位与位移的转换,传感器的理论分辨率 θ_{res} 可表示为:

$$\theta_{res} = \frac{f_c}{Nf_s} \times 1\ 296\ 000'' \tag{15}$$

式中: f_s 为高速脉冲信号频率; f_e 为感应信号频率,其与 激励信号频率保持一致;N 为传感器对极数。并且在 f_s 与 f_e 一定时,对极数N 越大对应传感器分辨率越高。 传 感器外环采用二次调制等效对极数加倍,故其理论分辨 率提升1倍。本测量系统中 f_s 等效于1600 MHz, f_e 为 20 KHz,传感器经过二次调制后等效于120 对极,由此可 得到传感器的理论分辨率为 0.135"。



Fig. 5 Sensor signal processing

4 实验结果分析与优化

4.1 实验结果

对原型传感器粗测部分整周误差、精测部分整周误 差、精测部分对极内误差进行测量,图 6 为传感器粗测部 分的误差曲线,如图所示误差大小为 3 349"。外环精测 环经过二次调制后对极数增加一倍,等效为 120 对极,单 个对极所对应的角度值为 3°即 10 800",粗测环误差小于 单对极对应的角度,可以实现绝对定位。



图 6 优化前粗测部分误差曲线 Fig. 6 Error and spectrum of rough measurement before optimization

图 7 所示为传感器精测部分整周误差与对极内误差及对应频谱图,图 7(a)为传感器的精测整周误差,误差大小为 11.1",图 7(b)所示为从整周误差中截取的传感器对极内误差,其误差大小为 8.2",对极内误差成分主要为一次谐波和四次谐波,且一次谐波幅值达到了 2.45"。



Fig. 7 Error and spectrum of fine measurement

传感器整周误差较对极内误差略大,这是由于传感 器安装制造误差引起的。传感器对极内误差中四次误差 由电场耦合时的非线性电场引起,但对极内误差中一次 谐波占比较大,需要进一步分析优化。

4.2 实验数据分析

从图 7(b)的频谱分析可知,精测部分对极内误差 中一次谐波误差占比较大。理想条件下,内外环各自 完成电场的两次耦合实现信号的二次调制。但从传感 器结构分析,传感器工作时,内外环同时施加了交流激励,当外环施加激励时,外环激励信号在第一级内环感 应电极上产生了串扰信号;同理,内环施加激励时,内 环激励将在第一级外环感应电极产生串扰信号。当内 外环同时工作时,申扰信号参与了第二级耦合从而引 入了测量误差。

为验证分析,仅在内环施加激励时,测量第一级外环 感应电极上的串扰信号;仅在外环施加激励时,测量第一 级内环感应电极上的串扰信号。串扰信号的大小如表1 所示。

表 1 串扰幅值 Table 1 Crosstalk amplitude

串扰位置	内环精测环	外环粗测环
串扰幅值/mV	4.4	5.1

从表中数据看出,当内外环同时工作时,存在一定的 串扰信号。显然,串扰信号将造成传感器感应信号的相 位发生畸变,以外环精测环为例分析内环对外环串扰引 起的感应信号相位畸变。

设内外环同时工作时,内环激励信号在第一级外环 感应电极上产生的串扰信号为 $\Delta U_0 = a \sin(\omega t + \alpha)$,其参 与了第二级耦合,考虑串扰信号的叠加可得到实际第二 级外环精测信号为:

 $U_{fine} = \left[K_{2}\sin(\omega t - N\theta) + \Delta U_{0}\right] \times 2r_{4}\Delta r_{4}(1 - \cos N\theta) + \left[K_{2}\cos(\omega t - N\theta) + \Delta U_{0}\right] \times 2r_{4}\Delta r_{4}(1 + \sin N\theta) + \left[-K_{2}\sin(\omega t - N\theta) + \Delta U_{0}\right] \times 2r_{4}\Delta r_{4}(1 + \cos N\theta) + \left[-K_{2}\cos(\omega t - N\theta) + \Delta U_{0}\right] \times 2r_{4}\Delta r_{4}(1 - \sin N\theta) = -4K_{2}r_{4}\Delta r_{4}\left[\sin(\omega t - 2N\theta) - a\sin(\omega t + \alpha)\right] = -4K_{2}r_{4}\Delta r_{4}\left[\sin(\omega t - 2N\theta) - a\sin(\omega t + \alpha)\right] = -4K_{2}r_{4}\Delta r_{4}\sqrt{\left[(\cos 2N\theta - 2a\cos\alpha)^{2} + (\sin 2N\theta - 2a\sin\alpha)^{2}\right]} \times \sin\left(\omega t + \arctan\frac{\sin 2N\theta - 2a\sin\alpha}{\cos 2N\theta - 2a\cos\alpha}\right)$ (16)

因此,将实际得到的外环感应信号与理论感应行波 信号进行相位比较,得到的相位偏差即为串扰信号引入 的误差:

$$E = \frac{1}{2N} \left(\arctan \frac{\sin 2N\theta - 2a\sin\alpha}{\cos 2N\theta - 2a\cos\alpha} - 2N\theta \right)$$
(17)

由式(17)可得到内环对外环产生的串扰信号在外 环精测环对极内测量结果中引入了一次误差,该误差大 小由串扰信号幅值和相位决定。进一步可得出内外环同 时工作时,内外环的串扰信号将在内环和外环分别引入 测量误差。

4.3 传感器分时优化

内外环同时工作时将引入相互间的串扰,采用分时 施加激励的优化方法可避免内外环受到对应的串扰影 响。当传感器外环工作时,内环停止工作,外环将不会对 内环产生串扰信号。同理,当传感器内环单独工作时,外 环将不会对内环产生串扰。 传感器上电初始阶段仅对内环施加激励信号,内环 得到传感器的绝对位置后,断开内环激励,对外环施加激 励信号得到精确的位置信息。内外环工作在不同的时间 段,可有效避免内外环同时工作时的串扰影响。根据此 优化方法对传感器进行精度测试,得到的传感器的误差 曲线如图 8 与 9 所示。

图 8 所示为传感器分时优化后的粗测误差曲线,其 大小为 3 037",仍满足绝对定位需求。图 9 所示为传感 器优化后精测整周误差与精测对极内误差,其中精测整 周误差为 8.2",对极内误差大小为 6.8",对极内误差中一 次谐波大小为 0.5",较优化前的 2.45"大幅降低。







- 图 9 优化后精测部分误差曲线及频谱
- Fig. 9 Optimized error and spectrum of fine measurement

优化后外环对极内误差中一次误差幅值大幅衰减的 实验结果进一步验证了外环受内环串扰叠加时 式(16)与(17)中的理论推导。同时,分时优化方法本质 上是基于串扰来源、实验分析及理论推导后,协调内外环 工作时间段以避免串扰的叠加影响所实现的。

在采用分时优化的基础上对传感器的实际分辨率进行测量。实验过程中通过逐步减小 RPI 转台的步长以得 到实际分辨率,测量结果如图 10 所示。经过二次调制后 其实际分辨率为 0.4"。



5 结 论

本文提出了一种采用多层传感结构实现信号二次 调制的高精度绝对式时栅角位移传感器。传感器利用 多层传感结构,拓展并利用了轴向空间,将传感器第一 级得到的内外环感应信号作为激励信号施加到第二级 内外环实现信号的二次调制。二次调制后得到等效对 极数为1的粗测信号与等效对极数加倍的多对极精测 信号,制造了外径 Φ=100 mm、内径 Φ=50 mm 的传感 器样机。经初步实验与分析验证后,传感器采用分时 施加激励的优化方法协调内外环工作时间段,避免了 内外环同时工作时的相互串扰影响,降低了精测环对 极内一次谐波误差的幅值。最终实验表明传感器可实 现绝对定位,精测环实际分辨率为0.4″,原始测量精度 达到±4.1″。

参考文献

 [1] 程强,徐文祥,刘志峰,等.面向智能绿色制造的机床 装备研究综述[J].华中科技大学学报(自然科学版), 2022,50(6):31-38.

CHENG Q, XU W X, LIU ZH F, et al. A review of machine tool equipment research for intelligent green manufacturing [J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2022, 50(6): 31-38.

- [2] OZTEMEL E, GURSEV S. Literature review of Industry
 4.0 and related technologies [J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2020, 31(1): 127-182.
- [3] 谭久彬. 超精密测量是支撑光刻机技术发展的基石[J]. 仪器仪表学报,2023,44(3):1-7.
 TAN J B. Ultra-precision measurement: The cornersto-ne of the lithography development [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2023,44(3):1-7.
- [4] 周亮,王振环,孙东辰,等.现代精密测量技术现状及

发展[J]. 仪器仪表学报,2017,38(8):1869-1878.

ZHOU L, WANG ZH H, SUN D CH, et al. Present situation and development of modern precision measurement technology [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2017, 38(8): 1869-1878.

- [5] KUMAR A S A, GEORGE B, MUKHOPADHYAY S C. Technologies and applications of angle sensors: A review[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21 (6): 7195-7206.
- [6] 王淑娴,彭东林,吴治峄,等. 伺服电机位置检测技术 综述[J]. 仪器仪表学报,2018,39(8):143-153.
 WANG SH X, PENG D L, WU ZH Y, et al. Review of position estimation techniques for servo motor [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2018, 39(8): 143-153.
- MATSUKUMA H, MADOKORO S, ASTUTI W D, et al. A new optical angle measurement method based on second harmonic generation with a mode-locked femtosecond laser [J]. Nanomanufacturing and Metrology, 2019, 2(4): 187-198.
- [8] YU H, CHEN X, LIU C, et al. A survey on the grating based optical position encoder [J]. Optics & Laser Technology, 2021, 143: 107352.
- [9] SHI Y, NI K, LI X, et al. Highly accurate, absolute optical encoder using a hybrid-positioning method [J].
 Optics Letters, 2019, 44(21): 5258-5261.
- [10] 张建辉,陈震林,张帆. 绝对式光电编码器的编码理论 研究进展[J]. 振动. 测试与诊断,2021,41(1):1-12.
 ZHANG J H, CHEN ZH L, ZHANG F. Advances in coding theory of absolute optical encoders[J]. Journal of Vibration, Measurement & Diagnosis, 2021, 41(1): 1-12.
- [11] YUAN P, HUANG D, LEI Z, et al. An anti-spot, highprecision subdivision algorithm for linear CCD based single-track absolute encoder [J]. Measurement, 2019, 137: 143-154.
- [12] 徐宗伟,李龚浩,兀伟,等. 滚压印圆柱母光栅的微刻 划制造[J]. 纳米技术与精密工程,2013,11(6): 473-478.

XU Z W, LI G H, WU W, et al. Precise micro-cutting fabrication of roller imprint cylindrical grating template[J]. Nanotechnology and Precision Engineering, 2013, 11(6): 473-478.

- YE G, LIU H, YAN J, et al. Fabrication of high edgedefinition steel-tape gratings for optical encoders [J]. Review of Scientific Instruments, 2017, 88 (10): 105006.
- [14] SHI L, ZENG L, LI L. Fabrication of optical mosaic gratings with phase and attitude adjustments employee latent fringes and a red-wavelength dual-beam interferometer [J]. Optics Express, 2009, 17 (24): 21530-21543.
- [15] WANG X, PANG Z, YANG H, et al. Theoretical study of subwavelength circular grating fabrication based on continuously exposed surface plasmon interference lithography[J]. Results in Physics, 2019, 14: 102446.
- [16] ZHAO C, WAN Q, LU X, et al. Moiré fringe signal subdivision system of a stained code disc of a grating displacement sensor [J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(9): 8614-8621.
- [17] 任雪玉,黄垚,薛梓,等. 一种光栅莫尔信号数字锁相 细分方法[J]. 仪器仪表学报,2021,42(3):25-34.
 REN X Y, HUANG Y, XUE Z, et al. A digital phaselocking subdivision method for grating Moiré signal [J].
 Chinese Journal of Scientific Instrument, 2021,42(3): 25-34.
- [18] 谢锐,马铁华,武耀艳,等.嵌入式容栅传感技术及轴 功率测试研究[J].仪器仪表学报,2012,33(4): 844-849.

XIE R, MA T H, WU Y Y, et al. Study on embedded capacitive grating sensing technology and shaft power testing [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2012, 33(4): 844-849.

- [19] 张宇鹏,徐钰蕾,王昱棠.高精度电容式角位移传感器 测量方法[J].仪器仪表学报,2014,35(S1):147-150.
 ZHANG Y P, XU Y L, WANG Y T. Measurement method of high-precision capacitive angular displacement sensor[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2014, 35(S1): 147-150.
- [20] HOU B, ZHOU B, SONG M, et al. A novel singleexcitation capacitive angular position sensor design [J]. Sensors, 2016, 16(8): 1196.
- [21] 王睿,李新娥,杜红棉,等.容栅式微小位移传感器边 缘效应研究[J]. 兵器装备工程学报,2019,40(9):

173-177.

WANG R, LI X E, DU H M, et al. Research on edge effect of capacitance micro displacement sensor [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2019, 40(9): 173-177.

[22] 彭凯,刘小康,于治成,等.电极几何尺寸误差对纳米时栅位移传感器测量精度的影响及其抑制方法[J]. 仪器仪表学报,2021,42(7):21-27.

PENG K, LIU X K, YU ZH CH, et al. The influence of electrode geometric size error on the measurement accuracy of nanometer time grating displacement sensor and its suppression method [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2021, 42(7): 21-27.

[23] PENG K, YU Z, LIU X, et al. Features of capacitive displacement sensing that provide high-accuracy measurements with reduced manufacturing precision [J].
 IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(9): 7377-7386.

作者简介



刘小康,1999、2002 和 2005 年于重庆大 学分别获得学士、硕士、博士学位,2008 年于 合肥工业大学仪器科学与技术博士后流动 站出站,现为重庆理工大学教授、北京理工 大学博士生导师,主要研究方向为智能仪器 与传感器。

E-mail: lxk@ cqut. edu. cn

Liu Xiaokang received his B. Sc. degree, M. Sc. degree and Ph. D. degree all from Chongqing University in 1999, 2002 and 2005, respectively. He finished his postdoctoral research at Hefei University of Technology in 2008. He is currently a professor at Chongqing University of Technology and a Ph. D. advisor at Beijing Institute of Technology. His main research interests include intelligent instruments and sensor.



康成蓥,2019年于重庆理工大学获得学 士学位,现为重庆理工大学硕士研究生,主 要研究方向为智能仪器与传感器。 E-mail: 15683550252@163.com

Kang Chengying received his B. Sc. degree

from Chongqing University of Technology in 2019. He is currently pursuing his master degree at Chongqing University of Technology. His main research interests include intelligent instruments and sensor.



于治成(通信作者),2012 年于重庆工 商大学获得学士学位,2015 年于重庆理工大 学获得硕士学位,2019 年于合肥工业大学获 得博士学位,现为重庆理工大学助理研究 员,主要研究方向为传感技术与智能仪器。

E-mail: yzc@ cqut. edu. cn

Yu Zhicheng (Corresponding author) received his B. Sc. degree from Chongqing Technology and Business University in 2012, received his M. Sc. degree from Chongqing University of Technology in 2015, and received his Ph. D. degree from Hefei University of Technology in 2019. He is currently an assistant research fellow at Chongqing University of Technology. His main research interests include sensing technology and intelligent instrumentation.